

Doc. No.: NR050621

2005年6月21日

独立モジュール構造を採用したバッチ式洗浄装置「FC-3100」を発売 ～受注から稼働開始までのリードタイムを大幅に短縮～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：末武 隆成)は、リードタイムを大幅に短縮した300ミリウエハー対応のバッチ式^{※1}洗浄装置「FC-3100」を7月1日から販売します。

微細化が進む半導体業界では、プロセス技術は線幅90ナノメートル(ナノは十億分の一)の世代に突入し、同時に次世代の65、45ナノメートルプロセスの開発も本格的に進められています。各半導体メーカーでは、より高い品質と生産性を持つ製造装置が不可欠となり、変化の激しい市場への迅速な対応が課題となっています。そのためウエハーの洗浄工程においても、工程ごとに最適なプロセスや装置形態が求められ、洗浄装置が担う役割もますます重要になっています。

今回発売する「FC-3100」は、300ミリ対応のウエハー洗浄装置としてベストセラーモデルとなったFC-3000の後継機種で、当社の主力製品となるものです。安定性・信頼性をさらに向上させるとともに、標準化された数種類のモジュールを用途に応じて組み合わせる独立モジュール構造を採用。この構造により、受注から納品までの製造リードタイム、およびセットアップ期間を短縮し、課題とされていた量産稼働に向けた設備の導入期間を大幅に削減することに成功しました。また、業界最高レベルの搬送速度を実現し、生産性の向上にも貢献します。

また、1つの槽ですべての処理を行う「シングルチャンバークリーニングシステム^{※2}」、ダメージを受けやすいウエハー表面の乾燥を可能にする「マランゴニ&減圧乾燥(LPD)^{※2}」、常にリン酸の最適な処理濃度を管理する「リン酸濃度フィードバックシステム」など、65ナノメートルプロセスに不可欠な各種の先進技術を搭載し、次世代デバイスの開発を進める半導体メーカーのニーズに応える装置となっています。

当社は、1999年にFC-3000を発売して以来、バッチ式洗浄装置のグローバルスタンダードとしての地位を確立し、全体では45.5%^{※3}、300ミリ対応装置としては約70%^{※4}という世界トップシェアを獲得しています。当社は今回の「FC-3100」の発売により、デバイスメーカーの多様な生産形態や次世代デバイスの開発に柔軟・迅速に対応することを視野に入れ、さらなるシェアの拡大を目指します。

※1 バッチ式
複数のウエハーを一度に処理できる方式。

※2 オプション

※3 2004年 世界オート・ウエット・ステーション市場売上シェア、ガートナー データクエスト調べ(2005年4月) GJ05210

※4 2005年6月現在、当社調べ

* この装置は、7月12日から14日までアメリカ・サンフランシスコで開催される「SEMICON WEST」でご紹介します。

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目

<販売開始予定>

2005年7月1日

<国内希望販売価格(消費税別)>

約2億5,000万円～4億円

※ 価格は仕様により異なります。

<年間販売台数(初年度)>

20台



FC-3100

☆ この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。
(<http://www.screen.co.jp/press/nr-photo/>)